Dispositivo para Trabajo bajo Campo Eléctrico Intenso Emplazable en Espectrómetros Mecánicos

Descripción de la tecnología

La presente invención se refiere al diseño e implementación de un dispositivo para la realización de ensayos de espectroscopía mecánica (también conocidos en inglés como " dynamic mechanical analysis" , o DMA), bajo la aplicación de un campo eléctrico intenso (superior a 100 kV/m). La presente invención puede ser emplazada en cualquier tipo de espectrómetro mecánico operando en oscilaciones torsionales o longitudinales. Los materiales a ser estudiados incluyen todo tipo de materiales poliméricos/dieléctricos sólidos. El dispositivo permite además realizar mediciones en función de la temperatura.

Aplicaciones

La presente invención puede ser utilizada en espectrómetros mecánicos operando tanto en unidades científico-académicas como en industrias. Este dispositivo puede ser utilizado para estudiar todo material dieléctrico que pueda ser susceptible de un ensayo de espectroscopía mecánica.

Ventajas

Esta invención presenta la novedad de permitir la realización de ensayos de espectroscopía mecánica bajo la acción de un campo eléctrico intenso.

Estado de desarrollo

Existe un prototipo en funcionamiento de esta invención.

Estado de la patente

Fecha de prioridad: 10/2/2013. Número de prioridad: AR2013P103580. En trámite en: Argentina.

Inventor referente

Dr. Osvaldo A.F. Lambri

Palabras claves : Industria | Estudio de Materiales | espectroscopía mecánica | campo eléctrico